# (19) 대한민국특허청(KR) (12) 실용신안공보(Y1)

(54) 출원명	반도체 칩 자동본당 장치			
(77) 심사청구	심사관: 조성욱 (책자공보 제1049호)			
(74) 대리인	이명필			
	경상남도 장원시 반림동 반송아파트 33동 502호			
	대한민국			
(72) 교안자	윤인철			
	경상남도 창원시 성주동 42번지			
	대한민국			
(71) 출원인	삼성항공산업주식회사, 이동복			
(22) 출원일자	1986년09월26일	(43) 공개일자	1988년05월31일	
(21) 출원번호	실1986-0014769	(65) 공개번호	실1988~0006986	
H01L 21/48		(11) 공고변호	실1989-0004245	
(51) Int. Cl.4		(45) 공고일자	1989년 06월 26일	

छक

내용 없음. 대표도

명세서

[고안의 명칭]

반도체 참 자동본딩 장치

[도면의 간단한 설명]

도면은 본 고만의 사시도.

· 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1: 검출기

2: 카메라 4 : XIXICH

3 : 테이블베이스 5:전등

6: 테이블 9:침

7.8.12: 모터 10: 투명시이트

11:웨이퍼 홈터

13:인터페이스희로 15: 구동제어리로

14: 연산처리회로 16: 아암구동부

17: 아암축 19: 이암부

18,18': 본딩아암 20 : 참 흡착구

[실용신안의 상세한 설명]

본 고만은 반도체 칩 자동 본팅 청치로서 특히 3개의 본당아암을 구비하고 집을 흡착하기전에 칩의 선명, 침의 위치정보통을 하여 본당 작업속도를 증가시킬 수 있는 반도체 칩 자동 본담 장치에 관한 것이다.

반도체 제조공정에 있어서 리이드 프레임상에는 반도체 집을 정확하게 본당하기 위해서는 집 공급 테이블위에 얹힌 침문상에서 한개의 침을 돈당장치의 아암 끝에 달린 흠착구로 흠착하여 제조라인상에 정열된 리이드 프레임의 기판상에 원하는 위치와 원하는 각도로 옮겨놓은후 평당하게 되는데, 기존의 본당 장치들은 하나의 아암을 갖으며 영상 인식장치를 이용하여 반도체 침을 인식 출작한 다음 칩을 리이드 프레임상으로 이송한후 정확한 본당 위치 조절을 위하여 예비 정열장치를 사용하여 칩을 전멸하여 리이드 프레임에 본당하도록 되어 있다. 그러나 이와같은 종래의 장치는 하나의 야암으로 칩을 흡화, 전염, 본당하기 때문에 시간이 많이 걸리며 매우 비능들적이었다.

본 고안의 목적은 이와같은 종래의 침 본당잠치의 한계점을 국복하고 보다 능률적인 본당 작업이 가능하도록하는 집 본당장치.

특히 3개의 아임을 갖는 회전가능한 아임부, 위치 변환 기능한 테이블위에 놓인 회전 가능한 칩 공급판, 상기 아암부, 테이블 및 칩 고급판을 구동하는 장치를 제어하기 위한 영상인식잠치, 연산 및 제어장치동을 구비하는 반도체 침 본당장치를 제공하는 것이다.

이히 도면에 따라서 본 고안의 한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 구동장치(16)에 의하여 회동되는 아완축(17)에 서로 120°간격을 두고 부착되어 있는 3개의 아암(18)을 가지는 본당 야암부(19)의 아래쪽에 모타(12)에 의하여 회전되는 웨이퍼 출터(11)가 모타(7)(8)에 의하여 XY방향 이동가능한 테이블(6)위에 회전 가능하게 설치되어있다. 샹기 웨이퍼출터(51)의 상판에는 반도체 칩(9)이 높이는 투명 사이트(10)가 마련되어 있고, 그 위쪽에는 카메라(2)로 부터 영상신호를 전달받아 디지탈 신호로 변환하는 검출기(1)가 지지대(4)에 설치되어 있다.

상기 검출기(1)는 인터페이스회로(13)를 거쳐 연산처리회로(14)에 연결되며, 연산처리회로(14)는 한편으로는 구동제어회로(15)를 거쳐 모다

(7)(8)(12)에, 다른 한편으로는 아양축(17)용 회통시키는 야양구동장지(16)에 연결된다. 마설명부호 3은 테이용베이스, 5는 전동, 20은 침 출착구이다.

이었음이 구성된 본 고인의 작용효교를 삼퍼보면 다음교 같다. 두명시아름(10)위에 놓인 만도채 집(9)의 양물양, 위치. 당충용 키메리(2)가 모축하여 감출기(1)로 보내면 삼기 집에 대한 아날로그 신호는 점출기(1)에서 디지당 신호로 변환단 후 인터페이스 최로(13)를 거쳐 연산권리장지(14로 보내이지).

연산권리장지(14)에서는 최어 대한 상기의 데이타를 입력받아 불량한 참으로 식별되면 다음 최이 카메라 만식 위치로 이승되도록 하며, 점상적인 최인 경우는 위치오차 및 방향오치에 따른 최연 x, 방향으로의 이용되어야 할 기고, 회전성이 할 각도등을 얻산 처리한 다음, 재어선청을 구동 제어회로(15에 발내어 모든(17)에서) 2를 구성시켜 하여 완하는 위치에 완하는 위도로 놓아도록 한다. 제기리에 놓인 칩을 본당 아완(18)이 그 집출하구(20)로 흡착하게되면 면산처리장지(14)와 연결된 여왕 구평장지에 의하여 본당 아왕부의 아왕숙(17)이 120 항권되어 본당 아왕(18)의 집 흡착구(20)가 반도체 저조라만(미도시)위에 대기하고 있던 리이드 프레임의 기반 위로 이용되고 잘고있던 집중 기관에서 대상하고 보였지만[1

한편 본당 아왕(18)의 회전과 동시에 다른 본당 아왕(도면에 만나타남) 이 투명시이트(10)위로 최전되어 다시 참의 위치 및 방향 조점 과정이 반복단다.

본 교안에 의한 장치는 3개의 본당 이왕을 구비하고 있으므로 하나의 이왕에서 칩의 위치와 방향을 조절하여 칩을 흡착하는 동안 다른 아암에서는 칩 군당적업을 동시에 진정할수 있으므로 집 본당작업 속도가 현재히 증가된다.

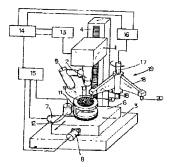
## (57) 청구의 병위

#### 친구한 1

같이도 단점점에 반도된 힘을 본당하기 위하여 침몰자구를 그 선단에 갖춘 본당 아임부, 반도체 집 공급테이끌음 구비하는 것에 있어서, 싱기 본당 이망부(1)라는 구동절치(1)에 의해 희롱되는 아암복(17)에 달린 3개의 ()현(18)를 기기제 모든(12)에 의하여 최정되는 웨이법 황단(17)에 가 모든(17)에에 의하여 'X'방향 이용기능된 테이필(8)위에 최진기능하기 최지되며, 싱기 웨이템 폴단(11)의 취속에는 점심식으청(2(()(17) 설치되어 환연으로는 선천리회포(14), 구쪽제어회포(15)를 가게 모든(7Xe)(12)에, 다른 한편으로는 연산제어회포(14), 아암구동정치(16)에 검색당이 있는 것을 목적으로 하는 반호해 집 자동부당 정치.

## 도면

#### 도면 1



# (19) Korean Intellectual Property Office (KR) (12) Notice of Publication of Registration (Y1)

(51) Int. Cl. <sup>4</sup> H01L 21/48		(45) Publication Date June 26, 1989 of Registration: (11) Registration No.: 1989-0004245
(21) Appln. No.: (22) Filing Date: (65) Publication No.: (43) Publication Date:	20-1986-0014769 September 26, 1986 20-1988-0006986 May 31, 1988	(73) Patentee Samsung Aeronautics Co., Ltd. 42 Seonglu-dong, Changwon-si, Gyeongnam, Republic of Korea (72) Inventor(s) In-Cheol YUN 33-502 Bansong APT., Banlim-dong, Changwon-si, Gyeongnam, Republic of Korea
		(74) Patent Attorney Young-Pil LEE
		Examiner: Seong-Wuk JO

## (54) APPARATUS FOR AUTOMATICALLY BONDING A SEMICONDUCTOR CHIP

## (57) Abstract

In an automatic apparatus for bonding a semiconductor chip to a leas frame including a bonding arm to which a chip absorber is installed at an end portion thereof and a chip table, the bonding arm includes an arm shaft that has three arms and is driven by a driver and a wafer holder, which is rotated by a motor, is located on a table that is movable in x-y plane by another motors. Image detectors are installed over the wafer holder. A first portion of the image detector is connected to the motors through an operation circuit and control circuit and a second portion of the image detector is connected to the operation circuit and the driver for driving the bonding arm.